

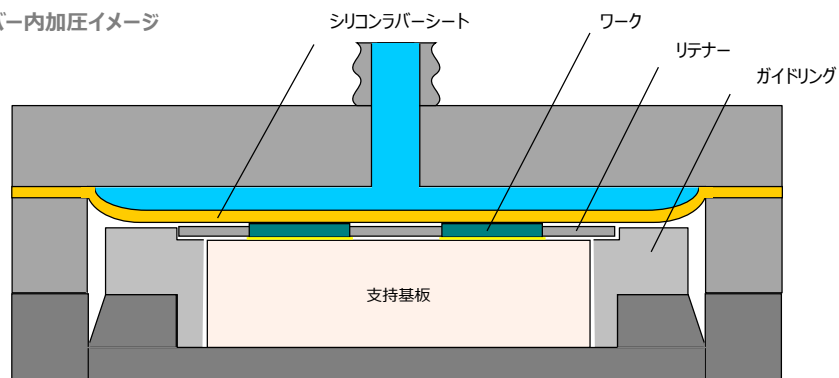


ウェハ貼付装置装置

ウェハサイズ	3~6 inch
支持板	~φ190mm
重量	280kg
サイズ	W830×D800×H1582mm
設定温度範囲	室温~140℃
圧力設定範囲	0.05~0.3Mpa
入力電源	AC200V 1PH 50/60Hz
消費電力	35A
供給気体圧力	0.4~0.5MPa 700L/min(ANR) ※クリーンドライエアー
操作	マニュアル
対応アプリケーション	化合物、セラミクス、金属、ガラス



チャンバー内加圧イメージ



北川グレステック株式会社
ラップ研磨関連装置カタログ

北川グレステック株式会社
千葉市花見川区犢橋町1614-27
TEL: 043-301-5408 HP: www.kitagawagt.co.jp
Kitagawa Gress Tech Co.,LTD



卓上型研磨装置

装置型式	LPM-15	LPM-18
定盤サイズ	φ380mm	φ457mm
対応ワークサイズ	~φ140mm	~φ180mm
重量	85kg	95kg
サイズ	W710 D 650 H 520mm	W820 D 730 H 620mm
操作	マニュアル	
対応アプリケーション	化合物、セラミクス、金属、ガラス	



据置型小型研磨機

装置型式	LPM-15	LPM-18
定盤サイズ	φ380mm	φ457mm
対応ワークサイズ	~φ140mm	~φ180mm
重量	320kg	400kg
サイズ	W 735 D 765 H1780mm	W 780 D 910 H1780mm
操作	マニュアル	
対応アプリケーション	化合物、セラミクス、金属、ガラス	



量産向据置型研磨機

装置型式	LPM-24	LPM-36	LPM-48
定盤サイズ	φ610mm	φ914mm	φ1219mm
対応ワークサイズ	~φ248mm	~φ368mm	~φ505mm
重量	1300kg	1500kg	3500kg
サイズ	W1415 D 1050 H 1550mm	W1730 D 1300 H 1600mm	W2040 D 1720 H 1600mm
操作	マニュアル		
対応アプリケーション	化合物、セラミクス、金属、ガラス		



加圧機構付据置型研磨機

装置型式	LPM-24	LPM-36	LPM-48
定盤サイズ	φ610mm	φ914mm	φ1219mm
対応ワークサイズ	~φ248mm	~φ368mm	~φ505mm
重量	1750kg	2100kg	4250kg
サイズ	W1415 D 1050 H 1800mm	W1730 D 1300 H 1955mm	W2040 D 1720 H 2240mm
操作	マニュアル		
対応アプリケーション	化合物、セラミクス、金属、ガラス		



電子ディスペンサー

圧縮空気と開閉弁により定量的に液体を供給する機器で、スラリーとルブリカント用に2系統用意され、それぞれ供給時間・間隔の設定が可能です。吐出力はエアレギュレーターの調整で管理されます。



スプレーヘッド (シングル/デュアル)

・シングル

現在は250mm、380mmの2タイプのご案内が可能です。

・デュアル

スラリーとルブリカントの供給を一箇所に纏められます。現在は340mm、495mmの2タイプのご案内が可能です。



スター/チューブポンプ

- ・スターはスラリーの攪拌にご使用いただけます。
- ・チューブポンプはスラリーを滴下供給したいお客様に推奨しております。



スラリータンク

- ・容量20Lと40Lの2タイプ



鑄鉄定盤

鑄鉄製のラッピングプレート。GCやWA/パウダー等遊離砥粒を使用したラッピングに最適です。



鑄鉄/セラミック修正リング

ラッピング定盤に供給された砥粒を均一にプレート表面にチャージングさせます。また定盤内外にオーバーハングさせることにより定盤の形状変化を軽減させます。



ダイヤモンド電着修正リング

ケメットプレート(定盤)は樹脂混合プレートのため、ダイヤモンド修正リング・ペレットにより平坦度の修正が可能です。



ダイヤモンドペレットリング

ケメットプレートを効率的に削り、目詰まり除去や平坦度修正に適したリングです。



光学フラット

鏡面仕上げ面との接触によって生ずる光波の干渉縞を観察することで、鏡面仕上げ面の平面度を測定できます。
材質：石英(合成)



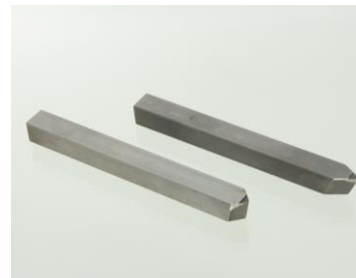
ハンドラップキット

作業現場で即座に手研磨をすることができます。またワークの数が少なく、研磨機を導入の必要がない場合にも最適な製品です。



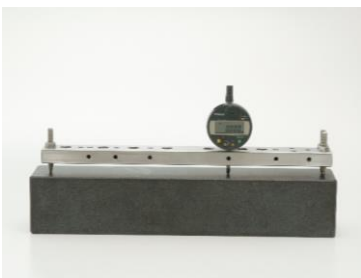
モノクロマチックライト

長寿命のナトリウムランプを使用しており、光学フラットと併用する事で干渉縞の確認が容易になります。



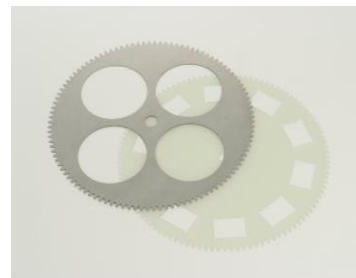
フェーシングバイト

ラッピング定盤を切削し、定盤の平坦度修正に使用可能です。バイトの再研磨も承っております。



フラットネスゲージ

ラッピング定盤の平面性をマイクロオーダーで管理するための機器です。ラッピング定盤サイズに合わせて設計・製作します。



キャリア各種

EG、PVC、SUS等材料各種ご案内可能です。少量・短納期・コスト等のお困り事の解消にお役立ていただけます。



Tバー

直径15インチ以下の定盤を装置に載せたり、装置から降ろしたりする際にご使用いただけます。



ワックスシリーズ

低温溶解し、低粘度のため薄く貼れる高精度品に最適なワックスもラインナップしております。適度に短時間で硬化し、作業性・洗浄性にも優れています。